Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U003299

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-07-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стародубцев Микола Григорович
2. Starodubtsev Nikolaj.G.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.27.06

Назва наукової спеціальності: Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 08-07-2004

Спеціальність за освітою: 8.091001

Місце роботи здобувача: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.052.03

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: проспект Науки, 14, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 45.01.85

Тема дисертації:

1. Операційний контроль формоутворення напівпровідникових пластин у виробництві приладів електронної техніки

2. Operational control of processing of semi-conductor plates in manufacture of devices of electronic engi-neering

Реферат/анотація:

1. Об’єкт - технологічний процес автоматичного контролю товщини пластин; мета - підвищення продуктивності технологічного процесу формоутворення пластин і якості їхньої поверхні за рахунок розробки автоматичного операційного контролю товщини пластин в процесі їх формоутворення; методи - методи математичного моделювання фізичних процесів у напівпровідниках, також застосовувалися теорія автоматичного керування й оптимізації, методи прикладного програмування, методи імітаційного моделювання; результати – отримано співвідношення для оцінювання питомого тиску вирівнювання пластин перед шліфуванням на основі дослідження процесу вирівнювання, – розроблено математичну модель та виконано моделювання процесу механічної обробки пластин, – розроблено метод автоматичного операційного контролю товщини пластин в процесі обробки, шляхом сполучення операцій формоутворення пластин і контролю їхньої товщини, – розроблена комп'ютерна модель автоматичного операційного контролю товщини пластин, – розроблено технологіч-ний процес автоматичного контролю товщини

пластин і рекомендацій зі створення спеціалізованого робочого місця автоматичного контролю; новизна – вперше розроблено метод розрахунку залишкових напруг у багатошаровій пластині з ізотропними шарами за деформаційними кривими, – вперше розроблено математичну модель та виконано моделювання процесу механічної обробки пластин, – вперше доведено необхідність створення та виконано теоретичне обґрунтування методу автоматичного контролю товщини пластин протягом операції їх формоутворення, – одержав подальший розвиток ємнісний метод виміру товщини пластин, – вперше побудовано та досліджено комп'ютерну модель автоматичного операційного контролю товщини пластин; впровадження - результпти впроваджено в експлуатацію на підприємстві ХГПЗ ім. Т.Г.Шевченка, м. Харків; галузь - підприємства із виробництва елементної бази електронної техніки, елементів та приладів електронно-обчислювальної техніки та галузеві науково-дослідні інститути

2. Object - technological process of the automatic control of thickness of plates; purpose - increase of productivity of technological process of machining of plates and qualities of their surface due to development of the automatic operational control of thickness of plates; methods - methods of mathematical modelling of physical processes in semiconductors, the theory of automatic control and optimization, methods of applied programming, methods of imitating modelling; results - are received parities for definition of specific pressure necessary for alignment of plates before grinding, - the mathematical model is developed and modelling process of machining of plates is carried out, - the method of the automatic operational control of thickness of plates is developed during processing, - the computer model of the automatic operational control of thickness of plates is developed, - technological process of the automatic control of thickness of plates and recommendations for creation of a workplace of theautomatic operational control of thickness of plates is developed; innovation - the method of calculation of residual pressure in a multilayered plate with isotropic layers on a deformation curve for the first time is developed, - for the first time is developed mathematical model and modelling process of machining of plates is executed, - necessity of creation for the first time is proved and the theoretical substantiation of a method of the automatic control of thickness of plates is executed during performance of operation of their machining, - has received the further development capacitor a method of measurement of thickness of plates, - the computer model of the automatic operational control of thickness of plates for the first time is developed and investigated; introductions - results are introduced at the KSEF him T.G.Shevchenko, Kharkov; usage sphere - enterprises for manufacture of element base of electronic engineering and branch scientific research institutes.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Невлюдов І.Ш.

2. Nevljudov Igor S.

Кваліфікація: д.т.н., 05.11.14

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Овчаренко В.Є.

2. Овчаренко В.Є.

Кваліфікація: д.т.н., 05.13.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Воронов С.О.

2. Воронов С.О.

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Шокало В.М.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шокало В.М.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.